

納入実績表

2012年3月23日

	納入先	部署名	装置名	年	備考
1	日新電機	研究開発部	研究用MBE	1985	
2	日新電機	研究開発部	量産用MOCVD	1985	
3	日新電機	研究開発部	研究用MBE	1986	
4	日新電機	研究開発部	研究用MBE	1987	
5	某メーカー	半導体事業部技術開発部	量産用MOCVD(- 2×16、3×8ハレル)	1987	
6	某メーカー	生産技術部(半導体)	量産用MBE(- 3×4 Mother BEe 4室)	1988	
7	日新電機	研究開発部	汎用MOCVD	1988	
8	某メーカー	オプトエレクトロニクス研究所	汎用MOCVD(燐系対応 3×1)	1988	
9	某メーカー	生産技術部(半導体)	量産用MBE(- 3×4 Mother BEe 全自動 5室)	1989	
10	日新電機	研究開発部	汎用MOCVD(- 社内デモ機)	1990	
11	大阪大学	基礎工学部物性物理工学科	研究用MBE(-)	1991	
12	東京理科大学	基礎工学部電子応用工学科	研究用MBE(-)	1991	
13	日新電機	研究開発部	UHV - STMシステム(社内研究用)	1991	
14	某メーカー		量産用GSMBE(- 全自動、CtoC、材料補給機構 4室)	1991	
15	東京大学	工学部電子工学科	研究用MBE(レーザーラマン分光計測)	1991	移:高知工科大
16	神奈川大学	工学部	研究用MOCVD	1991	
17	某メーカー	半導体事業部技術開発部	汎用MOCVD	1991	
18	無機材質研究所	第2研究グループ	研究用MBE(金属)	1992	
19	神奈川県工試	応用物理部応用物理科	研究用MBE(-)	1992	
20	千葉大学	工学部電気電子工学科	研究用MBE(-)	1992	
21	大阪市立大学	工学部応用物理学教室	研究用MBE(有機)	1992	
22	理化学研究所	半導体工学研究室	研究用MBE(-)	1992	移:東工大
23	日新電機	研究開発部	MOCVD(社内研究開発用 新型搬送システム)	1992	
24	某メーカー		汎用MOCVD(- 2×1)	1992	
25	某メーカー		研究用MBE(Si系 EB蒸発源付)	1993	
26	某メーカー		生産用MBE(-)	1993	
27	某メーカー		UHV - CVD用搬送機構	1993	
28	関西学院大学	理学部物理学科	研究用MBE(誘電体薄膜用)	1993	
29	某メーカー		研究用MBE(- マルチフラックス)	1993	
30	某メーカー		UHV搬送機構(Si系薄膜成膜装置)	1993	
31	神戸大学	工学部電気電子工学科	研究用MBE(- 変調光反射測定)	1993	
32	日新電機	研究開発部	汎用MOCVD(社内研究開発用 CtoC対応)	1993	
33	某メーカー		CVD+ラビッドサーマルアニール(6×1 絶縁膜対応)	1993	
34	某メーカー		汎用MOCVD(ガス系+排気系システム)	1993	
35	某メーカー		汎用MOCVD高機能化	1993	
36	大阪府立大学	付属研究所	研究用MBE(-)	1994	

納入実績表

37	九州大学	工学部	研究用MBE(Si系 低エネルギーイオン銃付)	1994	
38	龍谷大学	Extensionセンター	研究用MOMBE(- 全MO対応)	1994	
39	某メーカー		汎用MOCVD	1994	
40	某メーカー		研究用MOCVD(- 3×1)	1994	
41	某メーカー		汎用MOCVD(- 3×1 ALN)	1994	
42	千葉大学	工学部電気電子工学科	研究用MOCVD(- 2×1 - 兼用)	1994	
43	北陸先端大学	材料科学研究科	研究用MBE(Si系 3室)	1995	
44	名古屋大学	工学部結晶材料工学専攻	研究用MBE(Si系 2室 ガスソース対応)	1995	
45	北陸先端大学	材料科学研究科	研究用レーザーMBE(Si系 3室 EB蒸発源付)	1995	
46	京都大学	ベンチャービジネスラボラトリー	研究用MBE(有機+無機成膜室 特殊セル 4室)	1995	
47	宇宙科学研究所		研究用MBE(Si系 EB蒸発源付 VG分析系接続)	1995	
48	某メーカー		量産用MOCVD(- GaInAsP系 2×3)	1995	
49	名古屋大学	大学院工学研究科材料機能	研究用MOCVD(- 2×1 V族有機金属対応)	1995	
50	NHK放送技研	表示デバイス部	研究用MBE(- MBE+高真空ハット+ESCA 5室)	1996	
51	韓国SUNMOON大学	電子情報通信工学部	研究用MBE(GaN ECRラジカルセル付)	1996	
52	NTT	基礎研究所	研究用MOCVD(- GaInAsP系 2×1)	1996	移: Spring-8
53	上智大学	理工学部電気電子工学科	研究用MOCVD(GaInAsP系、全MO対応、3×1)	1996	
54	上智大学	理工学部電気電子工学科	研究用MBE(GaN 2成膜室 4室)	1997	
55	京都大学	工学部	多目的プラズマ実験装置+搬送ロボット	1997	
56	某メーカー		レーザーアブレーション(Si微粒子製作装置)	1997	移: 京都大学
57	某メーカー		量産用MBE(- ガスソースMBE 4室)	1997	
58	三重大学	工学部電気電子工学科	研究用MOCVD(GaN)	1997	
59	関西学院大学	理工学部	研究用MBE(GaAs)	1998	
60	原研(Spring8)	放射光利用研究部	研究用MBE(放射光利用)	1998	
61	東北大学	金属材料研究所	研究用MBE(ANELVA製成膜室と交換)	1998	
62	大阪大学	大学院工学研究科物質・生命	研究用MBE(有機 3室)	1998	
63	名古屋大学	大学院工学研究科材料機能	研究用MBE(-)	1998	
64	大阪工技研	材料物理部	UHV成膜装置(超高純度材料創製用 2室)	1998	
65	大阪産総技研	材料技術部	研究用MBE(薄膜極微細構造制御装置+STM+AFM 4室)	1998	
66	大阪大学	大学院基礎工学研究科物理系専攻	研究用MBE(超微粒子多層膜 EB蒸発源付)	1998	
67	東京工業大学	精密工学研究所	酸化装置(VCSEL)	1998	
68	某メーカー		熱CVD(SiC+その他)	1998	
69	奈良先端大学	物質創製科学研究科	研究用MOCVD(強誘電体薄膜)	1998	
70	奈良先端大学	物質創製科学研究科	研究用MOCVD(Siエピ)	1998	
71	奈良先端大学	物質創製科学研究科	研究用MBE(- 拡張:成膜室+搬送室 4室)	1998	
72	東京工業大学		研究用MOCVD(- ALGaAs)	1999	
73	佐賀大学	理工学部電気電子工学科	研究用MOCVD(-)	1999	
74	某メーカー		マニピュレータ+搬送機構(量産MBE用)	1999	
75	某メーカー		マニピュレータ	1999	

納入実績表

76	北海道大学	電子科学研究所	研究用MBE(GaAs, InAs, GaSb)	1999	
77	日本大学	理工学部物理学教室	研究用MBE(MPX:磁性材料)	1999	
78	北陸先端大学	材料科学研究科	研究用MOCVD(強誘電体薄膜)	1999	
79	(財)新機能素子協会		SiC用CVD装置	2000	
80	名古屋大学	工学部	研究用MOCVD装置(- +STM)	2000	
81	豊田工業大学		研究用MBE装置(有機薄膜+STM)	2000	
82	大阪工業大学	電子工学科	研究用MBE装置(ZnO膜)	2000	
83	某メーカー		酸化装置(VCSEL)	2000	
84	(財)新機能素子協会		SiC用CVD排気システム	2000	
85	産業技術総合研究所		研究用MOCVD装置(酸化物)	2000	
86	某メーカー		真空ベーキング装置	2000	
87	山形大学	工学部	研究用MBE装置(- 用、金属用+ 搬送室 4室)	2000	移:奈良先端大学
88	某メーカー		研究用MOCVD装置(- GaInNAs)	2001	
89	埼玉大学	工学部	酸化分析装置(SiC)	2001	
90	NHK放送技研		CL測定装置	2001	
91	某メーカー		酸化CVD装置(SiC)	2001	
92	産業技術総合研究所		研究用MOCVD装置(酸化物)	2001	
93	産業技術総合研究所		研究用MBE装置(CIGS太陽電池)	2001	
94	名古屋大学		研究用MBE装置(InP)	2001	
95	豊田工業大学		研究用MOMBE装置(GaInNAs)	2002	
96	某メーカー		酸化装置(VCSEL)	2002	
97	某メーカー		研究用MOCVD装置(AIGaN/GaN 2×3)	2002	
98	東京理科大学		研究用MBE装置(GaAs+STM)	2002	
99	奈良先端大学	物質創製科学研究科	研究用CVD装置(クロライド系Si)	2003	
100	豊橋技術科学大学		研究用MBE装置(GaInNP, Si 2成膜室 4室)	2003	
101	某メーカー		新型酸化装置VOX3001(VCSEL)	2003	
102	某メーカー		研究用MOCVD装置(GaN 2×3)	2003	
103	名城大学		研究用MOCVD装置(AIN)	2003	
104	某メーカー		新型酸化装置VOX3001(VCSEL)	2004	
105	北海道大学	電子科学研究所	研究用MBE装置(ZnSe, ZnTe, ZnO)	2004	
106	三重大学	工学部電気電子工学科	研究用MOCVD装置(GaN)	2004	
107	三重大学	工学部電気電子工学科	アンモニア排ガス処理装置	2004	
108	豊橋技術科学大学	工学部電気電子工学科	研究用MOCVD装置(GaInNP)	2004	
109	産業技術総合研究所		アンモニア排ガス処理装置	2004	
110	名城大学		研究用MBE装置(カーボンナノチューブ)	2004	
111	京都大学	大学院工学研究科	研究用酸化アニール装置	2004	
112	某メーカー		プラズマCVD装置(Si)	2004	
113	東北大学	金属材料研究所	研究用MBE装置(ZnO)	2005	移:東京大学
114	某メーカー		モニター付新型酸化装置iVOX3001(VCSEL)	2005	

納入実績表

115	某メーカー		研究用MBE装置(ZnO)	2005	
116	某メーカー		研究用MOCVD装置(GaN 2×3)	2005	
117	某メーカー		アンモニア排ガス処理装置	2005	
118	関西学院大学	理工学部	分析チャンバ	2005	
119	産業技術総合研究所		研究用MBE装置(CIGS太陽電池)	2005	
120	某メーカー		研究用MOCVD装置(GaN)	2006	
121	某メーカー		研究用MOCVD装置(- GaAs)	2006	
122	某メーカー		モニター付新型酸化装置iVOX3001(VCSEL)	2006	
123	京都大学		研究用CVD装置(ZnO)	2006	
124	某メーカー		高温真空炉	2006	
125	立命館大学	理工学部	研究用MBE装置(InN)	2007	
126	某メーカー		モニター付新型酸化装置iVOX3001(VCSEL)	2007	
127	関西学院大学	理工学部	SiC高温炉	2007	
128	某メーカー		ベーキング炉	2007	
129	東京大学	工学部	研究用MBE装置(Si)	2007	
130	某メーカー		成長素過程解析装置	2007	
131	名城大学		研究用MOCVD装置(InN)	2008	移:名古屋大学
132	奈良先端大学	物質創製科学研究科	モニター付新型酸化装置iVOX3001(VCSEL)	2008	
133	某メーカー		研究用MBE装置(化合物薄膜)	2008	
134	名城大学		研究用MOCVD装置(AIN)	2008	移:名古屋大学
135	某メーカー		モニター付新型酸化装置iVOX4001(VCSEL)	2008	
136	某メーカー		生産用MBE装置(CIGS)	2009	
137	某メーカー		新型生産用酸化装置pVOX3001(VCSEL)	2009	
138	東北大学	金属材料研究所	研究用MBE装置(ZnO)	2009	移:東京大学
139	東京大学	工学部	研究用MOCVD装置(GaN)	2009	
140	産業技術総合研究所		研究用MBE装置(CIGS太陽電池)	2009	
141	京都工芸繊維大学		研究用MBE装置(GaN)	2009	
142	京都大学		研究用CVD装置(有機)	2010	
143	名古屋大学		研究用MOCVD装置(GaN)	2010	
144	東京工業大学		酸化装置(VCSEL)	2010	
145	物質・材料研究機構		研究用MOCVD装置(AIN)	2010	
146	某メーカー		研究用MBE装置(CIGS)	2010	
147	京都大学		蒸着装置	2011	
148	某メーカー		ベーキング炉	2011	
149	某メーカー		研究用MOCVD装置(AIN)	2011	
150	某メーカー		生産用MBE装置(-)	2011	
151	立命館大学		スパッタ装置(CIGS)	2011	
152	某メーカー		SiC高温炉	2011	
153	某メーカー		ポリシリコンCVD装置	2011	

